



紹介

GTSガススクラバーは、MCVDおよびプラズマ堆積装置からのプロセス廃水を処理する排ガス処理システムです。GTSスクラバーは、プリフォーム製造プロセスから生じるシリカ粒子や汚染物質を除去します。GTSのサイズと精製能力は、設置された蒸着ラインの数に適合させることができ、一台のMCVDから6台(最大10台)の蒸着ラインまで対応できます。GTSは、最小限のメンテナンスと費用で、自動モードで継続的に動作するように設計されています。

アプリケーション

GTSスクラバーは、四塩化ケイ素(Si、Ge、Pなど)を基本的なガラス形成前駆体として使用し、MCVDまたはプラズマ堆積プロセスによって光ファイバープリフォームを製造する施設または実験室に、中央排気および排ガス処理システムとして設置されます。GTSスクラバーは、欧州の標準的な環境基準に従って、このようなプロセスから生じるすべての汚染物質(すす粒子、塩素、塩酸塩、フッ化水素蒸気、その他の製品)を効率的に除去します。GTSスクラバーは、蒸着装置の接続点で安定した連続排気を提供し、一定で再現性のあるプロセス条件に貢献します。

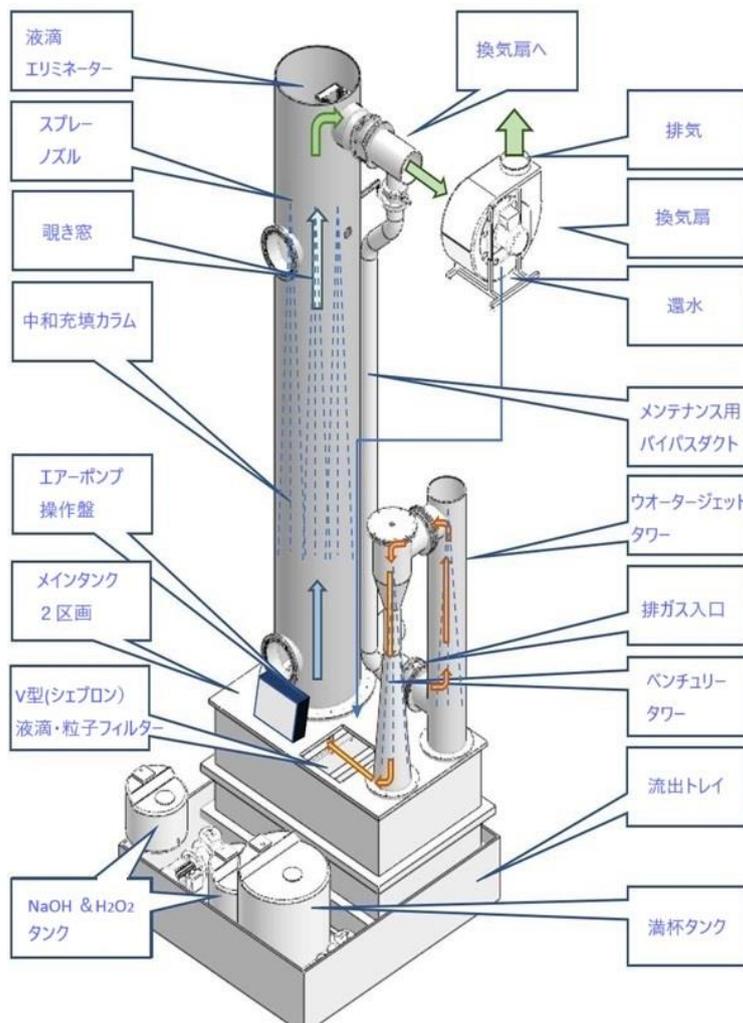
説明

GTSスクラバーは、ウォータージェットとベンチュリセパレーターを使用して、排出ガスから粉塵粒子を除去し、充填塔中和塔で中和します。2つのセクションを持つタンクをベースとして使用し、各セクションに苛性スクラビング液の循環流があります。中和および還元薬品は、PIDコントローラによるpHおよび酸化還元センサー制御を使用して、貯蔵タンクから自動的に投与されます。循環液は随時交換され、負荷にもよりますが、通常、年間1~4回のメンテナンス停止が予想されます。飽和循環液はポンプで汲み上げ、処理業者に送る必要があります。

GTSスクラバーは、PLCのプログラムとタッチスクリーンモニターによって制御されます。GTSは、OptiFACT制御ソフトウェアで稼働するどのシステムからでも、小規模なラボでは、1台の蒸着装置で制御できます。

取り付け

GTSスクラバーは完全なシステムとして提供され、適切な基礎とインフラ接続を備えたスペースのみで完全に稼働します。納品には、制御システムや警報装置、接続部など、すべての相互接続ダクトとケーブルが含まれます。ご要望に応じて、MCVD/プラズマシステムやその他の機器からスクラバーまでの相互接続ダクトを設計することができます。その他のオプションには、HClまたはHFセンサー、排気ファンが故障した場合の自動切り替え、施設安全システムへのインターフェースなどがあります。



詳細お問合せ先;

合同会社ヒロ・デザイン・ファクトリー

tel:070-3837-9360 Web:<https://www.hiro-df.com> e-mail:info@hiro-df.com